

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成16年12月2日(2004.12.2)

【公表番号】特表2000-506275(P2000-506275A)

【公表日】平成12年5月23日(2000.5.23)

【出願番号】特願平9-532043

【国際特許分類第7版】

G 0 1 N 21/88

【F I】

G 0 1 N 21/88 6 4 5 A

【誤訳訂正書】

【提出日】平成16年3月4日(2004.3.4)

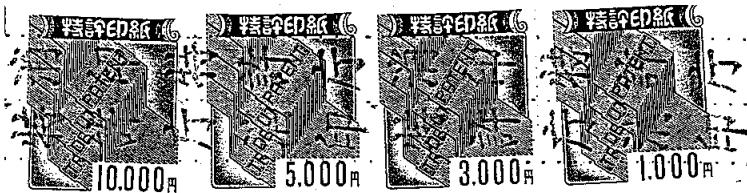
【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】補正の内容のとおり

【訂正方法】変更

【訂正の内容】



証 言 尺 言 丁 正 書

(19,000 円)

平成16年3月4日

特許庁長官 殿



1 事件の表示

平成9年特許願第532043号

2 特許出願人

住 所 アメリカ合衆国、カリフォルニア州 95051、
サン・ホゼ、リオ・ローブルズ 160
名 称 ケイエルエイーテンカー・コーポレーション

3 代 理 人

住 所 東京都千代田区永田町1丁目11番28号
相互永田町ビルディング8階
電話 3581-9371

氏 名 (7101) 弁理士 山 崎 行 造



4 訂正対象書類名

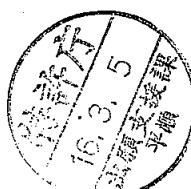
明細書、請求の範囲及び特許法184条の5第1項の規定による書面

5 訂正対象項目名

明細書、請求の範囲及び発明の名称

6 訂正の内容

別紙の通り

方
文
書

[誤訳訂正 1]

請求の範囲を以下の通り訂正する。

「請求の範囲」

1. サンプルの異常を検出する装置であって、

前記サンプルに2つのはぼ平行な光入射ビームを伝達する手段であって、

前記ビームはコヒーレントであるが異なる偏光を持つ手段と、

前記2つの入射ビームからの前記サンプルによって散乱された光を検出する少なくとも1つの暗視野検出器と、

前記2つの入射ビームの透過した部分の間の位相差又は前記サンプルによって前記2つの入射ビームの反射された部分の間の位相差を検出する明視野検出器とを備える装置。

2. 請求項1の装置において、さらに、前記2つのビームの前記サンプルを通過して伝達された部分又は前記2つのビームの前記サンプルから反射された部分を結合して結合ビームを形成する手段を備えており、前記明視野検出器が、

前記結合されたビーム又はそれから得られたビームを、異なる偏光の第1及び第2の出力ビームに分離する手段と、

前記第1及び第2の出力ビームを検出して2つの出力を提供するとともに、前記2つの出力の減算を行って位相シフト信号を提供する手段とを備える装置。

3. 請求項1の装置において、前記2つの入射ビームの一方が、該2つの入射ビームの他方よりも大きな強度を有する装置。

4. 請求項3の装置において、前記2つの入射ビームの一方が、該2つの入射ビームの他方よりも少なくとも20倍の大きさの強度を有する装置。

5. 請求項1の装置において、前記伝達手段が、

前記サンプルに向けてコヒーレントな光ビームを提供するレーザーと、

該レーザーから前記サンプルに向けて前記ビームを通過させ、さらに、該ビームの前記サンプルによって反射された部分を前記明視野検出器に向けて反射するビームスプリッターであって、入射した光の85%又はそれ以上を通過させるビームスプリッターとを備える装置。

6. 請求項1の装置において、前記伝達手段は透過性のある誘電体材料の本体を含む装置。

7. 請求項6の装置において、前記本体は、入射面と反射面とを有するブロック形状であり、前記2つの面は互いにほぼ平行であり、前記レーザーから提供された前記ビームは、2つの範囲の一方の値を持つ入射角度で前記入射面に向けられ、前記2つの範囲の前記一方の値は、前記誘電体材料のブリュースタ一角より大きく、前記2つの範囲の他方の値は、前記誘電体材料のブリュースタ一角より小さい装置。

8. 請求項 1 の装置において、前記 2 つの入射ビームは前記サンプルの少なくとも 2 つの領域を同時に照射し、少なくとも 1 つの前記暗視野検出器は、前記サンプルの前記同時に照射された領域によって散乱された光を検出し、前記明視野検出器は、前記サンプルの前記同時に照射された領域を通過した部分間又は前記サンプルの前記同時に照射された領域から反射された部分を検出する装置。

9. 請求項 1 の装置において、前記伝達手段は、P 偏光及び S 偏光の光を別々に反射し伝達する光学素子を含む装置。

10. 請求項 9 の装置において、前記光学素子は、P 偏光の光の 2 %から 5 %及び S 偏光の光の 47 %から 43 %を反射するが、P 偏光の光の 98 %から 95 %及び S 偏光の光の 53 %から 57 %を透過する偏光ビームスプリッターを備える装置。

11. 請求項 1 の装置において、前記少なくとも 1 つの暗視野検出器は橢円形のミラーを備える装置。

12. 請求項 1 の装置において、さらに、サンプルによって鏡面反射された、少なくとも 1 つの暗視野検出器からの、前記ビームの光をブロックする手段を備える装置。

13. サンプルの異常を検出する方法であって、

前記サンプルに 2 つのほぼ平行な光入射ビームを伝達する工程であって、前記ビームはコヒーレントであるが異なる偏光を持つ工程と、

前記 2 つの入射ビームからの前記サンプルによって散乱された光を検出する工程と、

前記サンプルを通過した前記 2 つの入射ビームの透過した部分の間又は前記サンプルによって前記 2 つの入射ビームの反射された部分の間の位相差を検出する工程とを含む方法。

14. 請求項 13 の方法において、さらに、前記伝達された部分又は反射された部分を結合して結合ビームを形成する工程を含んでおり、前記位相差検出工程は、

前記結合されたビーム又はそれから得られたビームを、異なる偏光の第 1 及び第 2 の出カビームに分割する工程と、

前記第 1 及び第 2 の出カビームの間の差を入手する工程とを含む方法。

15. 請求項 14 の方法において、前記入手する工程は、前記第 1 及び第 2 の出カビームを検出して 2 つの出力を提供するとともに、前記 2 つの出力を減算して前記位相差を提供する工程を含む方法。

16. 請求項 13 の方法において、前記 2 つの入射ビームの一方が、該 2 つの入射ビームの他方よりも大きな強度を有する方法。

17. 請求項16の方法において、前記2つの入射ビームの一方が、該2つの入射ビームの他方よりも少なくとも20倍の大きさを有する方法。

18. 請求項13の方法において、前記伝達工程が、

前記サンプルに向けてコヒーレントな光ビームを指向させる工程と、

レーザーから前記サンプルに向けて前記ビームを通過させ、さらに、該ビームの前記サンプルからの反射された部分を前記明視野検出器に向けて反射させるビームスプリッターを提供する工程であつて、該ビームスプリッターは、入射した光の85%又はそれ以上を通過させる工程を含む方法。

19. 請求項18の方法において、前記伝達工程は透過性のある誘電体材料の本体を提供する工程を備えていて前記コヒーレントなビームを前記サンプルに向けて通過させるとともに、前記サンプルによって反射されたものを明視野検出器に向けて反射し、前記本体は、入射面と反射面とを有するブロック形状であり、前記2つの面は互いにほぼ平行であり、前記伝達工程は、前記コヒーレントなレーザービームを所定の入射角度で前記入射面に指向する工程を含む方法。

20. 請求項19の方法において、さらに、前記指向工程の前に、前記誘電材料の屈折率及び所望の周辺可視性の関数として、前記入射角の最適値を決定する工程を備える方法。

21. 請求項13の方法において、前記伝達工程は、前記2つの入射ビームが前記サンプルの少なくとも2つの領域を同時に照射するようにし、前記2つの検出工程は、前記サンプルの同時に照射された領域から散乱された光を検出するとともに、前記サンプルの同時に照射された領域を通過して伝達された部分の間又は前記サンプルの同時に照射された領域から反射された部分の間の位相差を検出する方法。」

[誤訳訂正2]

明細書1ページ4行「本願発明は概略サンプルの偏差を検出する装置に関し、特に、半導体ウェーハ、フォトマスク、レクチル及びセラミックタイルのようなサンプル上の偏差等の異常を検出するためのシングルレーザの明視野及び暗視野装置に関する。」を「本願発明は、概略、サンプルの異常を検出する装置に関し、特に、半導体ウェーハ、フォトマスク、レクチル及びセラミックタイルのようなサンプル上の異常を検出するためのシングルレーザの明視野及び暗視野装置に関する。」に訂正する。

[誤訳訂正3]

明細書1ページ23行「従って、従来の装置及び提案された装置のいずれも完全に不満足である。従って、半導体デバイスの寸法より小さな偏差のみならず欠陥の構造上の特性とを検出することができるような、改良された偏差検出

装置を提供することが望まれている。」を「従って、従来の装置及び提案された装置のいずれも、完全に満足というわけではない。従って、半導体デバイスの寸法より小さな異常のみならず欠陥の構造上の特性とを検出することができるような、改良された異常検出装置を提供することが望まれている。」に訂正する。

[誤訳訂正4]

明細書2ページ6行「本願発明の1つの観点は、サンプルの偏差を検出する装置に関するもので、その装置は、そのサンプルに2つのほぼ平行な光入射ビームを伝達する手段を備える。」を「本願発明の1つの観点は、サンプルの異常を検出する装置に関するもので、その装置は、そのサンプルに2つのほぼ平行な光入射ビームを伝達する手段を備える。」に訂正する。

[誤訳訂正5]

明細書2ページ13行「本願発明の他の観点は、サンプルの偏差を検出する方法に関するもので、その方法は、そのサンプルに2つのほぼ平行な光入射ビームを伝達する工程であって、そのビームはコヒーレントであるが異なる偏光を持つ工程と、サンプルによってその2つの入射ビームから散乱された光を検出する工程と、2つの入射ビームの透過した部分の間又は2つの入射ビームのサンプルによって反射された部分の間の位相差を検出する工程とを含む。」を「本願発明の他の観点は、サンプルの異常を検出する方法に関するもので、その方法は、そのサンプルに2つのほぼ平行な光入射ビームを伝達する工程であって、そのビームはコヒーレントであるが異なる偏光を持つ工程と、サンプルによってその2つの入射ビームから散乱された光を検出する工程と、2つの入射ビームの透過した部分の間又は2つの入射ビームのサンプルによって反射された部分の間の位相差を検出する工程とを含む。」に訂正する。

[誤訳訂正6]

明細書2ページ20行「図1は、表面上の偏差を検出するために結合した明視野及び暗視野装置を示す概略図で、本願発明の望ましい実施例を図示する。」を「図1は、表面上の異常を検出するために結合した明視野及び暗視野装置を示す概略図で、本願発明の望ましい実施例を図示する。」に訂正する。

[誤訳訂正7]

明細書3ページ2行「図5は、サンプルの偏差を検出するために結合した明視野及び暗視野装置を示す概略図で、本願発明の望ましい実施例を図示する。」を「図5は、サンプルの異常を検出するために結合した明視野及び暗視野装置を示す概略図で、本願発明の望ましい実施例を図示する。」に訂正する。

[誤訳訂正8]

明細書3ページ7行「図1の装置10は本願発明の望ましい実施例を示すためのレーザー利用の走査型偏差検出装置である。」を「図1の装置10は本願発明

の望ましい実施例を示すためのレーザー利用の走査型異常検出装置である。」に訂正する。

[誤訳訂正 9]

明細書 6 ページ 10 行「ほとんどの偏差の場合には、位相差 $\delta \phi$ は小さいので、上述の線形処理を行うことができる。位相差の線形化の他の方法も用いることができる。例えば、C.W.See and M. Vaez-Iravani の「Linear Imaging in Scanning Polarization/Interference Contrast Microscopy」1986年9月25日、22巻、No. 20、1079-1081 頁に説明されたようなものがある。」を「ほとんどの異常の場合には、位相差 $\delta \phi$ は小さいので、上述の線形処理を行うことができる。位相差の線形化の他の方法も用いることができる。例えば、C. W .See and M. Vaez-Iravani の「 Linear Imaging in Scanning Polarization/Interference Contrast Microscopy」1986年9月25日、22巻、No. 20、1079-1081 頁に説明されたようなものがある。」に訂正する。

[誤訳訂正 10]

明細書 6 ページ 18 行「装置 10 の 1 つの重要な特徴は、測定された量 S は A、B の間の差分位相に線形応答するので、その測定された量 S は、差分位相の符号、つまり、偏差は表面 12 上のへこみなのか又は隆起なのかを保存するという点にある。」を「装置 10 の 1 つの重要な特徴は、測定された量 S は A、B の間の差分位相に線形応答するので、その測定された量 S は、差分位相の符号、つまり、異常は表面 12 上のへこみなのか又は隆起なのかを保存するという点にある。」に訂正する。

[誤訳訂正 11]

明細書 7 ページ 21 行「暗視野検出は小さな表面の偏差に対し非常に敏感にすることができますが、暗視野だけでは表面の偏差の構造的な特徴に関する情報を得ることはできない。上記のとおり、明視野に関して上述した位相検出方法は、一方の側のくぼみと他方の側の隆起との間の区別をすることができるので、そのような明視野検出を暗視野検出の補助として用いると表面の偏差に関するより多くの情報を得ることができます。」を「暗視野検出は小さな表面の異常に対し非常に敏感にすることができますが、暗視野だけでは表面の異常の構造的な特徴に関する情報を得ることはできない。上記のとおり、明視野に関して上述した位相検出方法は、一方の側のくぼみと他方の側の隆起との間の区別をすることができるので、そのような明視野検出を暗視野検出の補助として用いると表面の異常に関するより多くの情報を得ることができます。」に訂正する。

[誤訳訂正 12]

明細書 13 ページ 21 行「本願発明を、半導体ウェーハの表面のような不透明な表面 12 から反射された光の検出に言及しながら説明したが、透明な材料の

層の表面上又はその層の内部の偏差を検出するためにわずかに変更した装置を用いることができる。」を「本願発明を、半導体ウェーハの表面のような不透明な表面 12 から反射された光の検出に言及しながら説明したが、透明な材料の層の表面上又はその層の内部の異常を検出するためにわずかに変更した装置を用いることができる。」に訂正する。

[誤訳訂正 1 3]

明細書 1 ページ 2 行 「サンプルの偏差を検出するためのシングルレーザ明視野及び暗視野装置」を「サンプルの異常を検出するためのシングルレーザ明視野及び暗視野装置」に訂正する。

[誤訳訂正 1 4]

発明の名称「サンプルの偏差を検出するためのシングルレーザ明視野及び暗視野装置」を「サンプルの異常を検出するためのシングルレーザ明視野及び暗視野装置」に訂正する。

[訂正の理由等]

(訂正の理由 1 - 1)

誤訳訂正 1 による訂正は、PCT出願明細書 20 ページ及び 22 ページ（請求項 1 及び請求項 13）における "anomalies" の誤訳を訂正する補正である。

誤訳訂正前の、" anomalies "に対する翻訳「偏差」は必ずしも適切な翻訳とはいえないため、請求項の内容が不明確になっている。

ここで、" anomaly (anomalies の単数形) "には、「偏差」という意味もあるが「異常」という意味もある（訂正の理由 1 - 1 の説明に必要な資料「英辞郎 on the WEB」の該当箇所 [名 - 1] 参照）

したがって、" anomalies "を「異常」と訳すのが適当である。

(訂正の理由 1 - 2)

誤訳訂正 1 による訂正は、PCT出願明細書 20 ページ（請求項 1）における、"a bright field detector detecting any phase difference between transmitted or reflected portions of the two incident beams by the sample." の誤訳を訂正する補正である。

誤訳訂正前の翻訳「前記 2 つの入射ビームの透過した部分又は前記サンプルによって前記 2 つの入射ビームの反射された部分の間の位相差を検出する明視野検出器」が適切でない。

つまり、このように訳した場合、明視野検出器は、「入射ビームの透過した部分」を検出する機能、又は「前記 2 つの入射ビームの反射された部分の間の位相差」を検出する機能を持つ検出器であるかのような解釈を生むおそれがある。

" ...any phase difference between transmitted or reflected portions... " にお

いて" transmitted "も" reflected "も" portions "に掛かり、さらに" phase difference "は、これらのうちどちらかの" portions "の" phase difference "を意味している。つまり、明視野検出器は、「前記2つの入射ビームの透過した部分の間の位相差」を検出する機能、又は「前記2つの入射ビームの反射された部分の間の位相差」を検出する機能を持つ検出器を意味している。

したがって、これを明確にするためにはこの部分を、「前記2つの入射ビームの透過した部分の間の位相差又は前記サンプルによって前記2つの入射ビームの反射された部分の間の位相差を検出する明視野検出器」と訳すのが適当である。

(訂正の理由 1 - 3)

誤訳訂正1による訂正は、PCT出願明細書21ページ(請求項8)における、"...and the bright field detector detects the transmitted or reflected portions from the simultaneously illuminated areas of the sample."の誤訳を訂正する補正である。

誤訳訂正前の翻訳「前記明視野検出器は、前記サンプルの前記同時に照射された領域を通過した部分又は前記サンプルの前記同時に照射された領域から反射された部分の間の位相差を検出する」が適切でない。

すなわち、「間の位相差を」に対応する部分がないのにかかわらず翻訳に現れている。

したがってこの部分を削除して、「前記明視野検出器は、前記サンプルの前記同時に照射された領域を通過した部分又は前記サンプルの前記同時に照射された領域から反射された部分を検出する」と訳すのが適当である。

(訂正の理由 1 - 4)

誤訳訂正1による訂正は、PCT出願明細書22ページにおける請求項12、"The system of claim 1, further comprising means for blocking specularly reflected light of the beams by the sample from the at least one dark field detector."の誤訳を訂正する補正である。

誤訳訂正前の翻訳「請求項1の装置において、さらに、少なくとも1つの暗視や検出器からのサンプルによって反射された前記ビームの光を鏡のようにブロックする手段を備える装置」において"specularly"に対する翻訳「鏡のように」が適切でないため、全体として意味が不明確になっている。

"specularly"の元の形である"specular"には、「鏡の」という意味もあるが「鏡面反射」という意味もある(訂正の理由1-4の説明に必要な資料「英辞郎 on the WEB」の該当箇所[名-1]参照)。

ここで、"specularly"は"specular"の副詞形であると考えると、"specularly reflected"は、「鏡面反射された」と訳すのが適当である。さらに"from the at

least one dark field detector "は、" beams "に掛かることを明確にして、請求項 1 2 は、「請求項 1 の装置において、さらに、サンプルによって鏡面反射された、少なくとも 1 つの暗視野検出器からの、前記ビームの光をブロックする手段を備える装置」と訳すのが適当である。

(訂正の理由 2)

誤訳訂正 2 による訂正は、PCT 出願明細書 1 ページ 6 行の "anomalies" の誤訳を訂正する補正である。

既述の「訂正の理由 1 - 1」と同じ理由により "anomalies" の誤訳「偏差」を「異常」に訂正する。

(訂正の理由 3 - 1)

誤訳訂正 3 による訂正は、PCT 出願明細書 1 ページ 9 ~ 15 行の "anomalies" 及び "anomaly" の誤訳を訂正する補正である。

既述の「訂正の理由 1 - 1」と同じ理由により "anomalies" 及び "anomaly" の誤訳「偏差」を「異常」に訂正する。

(訂正の理由 3 - 2)

誤訳訂正 3 による訂正は、PCT 出願明細書 1 ページ 9 ~ 10 行の "Thus none of the conventional system or systems proposed is entirely satisfactory." の誤訳を訂正する補正である。

誤訳訂正前のこの文の翻訳「従って、従来の装置及び提案された装置のいずれも完全に不満足である。」において「完全に不満足である」の部分は、"satisfactory" を完全に否定しており、文法的におかしい。"none of A or B is entirely satisfactory." は、A は "entirely satisfactory" ということではなく ("entirely satisfactory" を否定)、かつ、B も "entirely satisfactory" ということはない ("entirely satisfactory" を否定) という意味だから。ここは、「従って、従来の装置及び提案された装置のいずれも、完全に満足というわけではない。」と訳すのが適当である。

(訂正の理由 4)

誤訳訂正 4 による訂正は、PCT 出願明細書 2 ページ 29 行の "anomalies" の誤訳を訂正する補正である。

既述の「訂正の理由 1 - 1」と同じ理由により "anomalies" の誤訳「偏差」を「異常」に訂正する。

(訂正の理由 5)

誤訳訂正 5 による訂正は、PCT 出願明細書 3 ページ 6 行の "anomalies" の誤訳を訂正する補正である。

既述の「訂正の理由 1 - 1」と同じ理由により "anomalies" の誤訳「偏差」を「異常」に訂正する。

(訂正の理由 6)

誤訳訂正 6 による訂正は、PCT出願明細書 3 ページ 17 行の "anomalies" の誤訳を訂正する補正である。

既述の「訂正の理由 1 - 1」と同じ理由により "anomalies" の誤訳「偏差」を「異常」に訂正する。

(訂正の理由 7)

誤訳訂正 7 による訂正は、PCT出願明細書 4 ページ 5 行の "anomalies" の誤訳を訂正する補正である。

既述の「訂正の理由 1 - 1」と同じ理由により "anomalies" の誤訳「偏差」を「異常」に訂正する。

(訂正の理由 8)

誤訳訂正 8 による訂正は、PCT出願明細書 4 ページ 12 行の "anomaly" の誤訳を訂正する補正である。

既述の「訂正の理由 1 - 1」と同じ理由により "anomaly" の誤訳「偏差」を「異常」に訂正する。

(訂正の理由 9)

誤訳訂正 9 による訂正は、PCT出願明細書 8 ページ 8 行の "anomalies" の誤訳を訂正する補正である。

既述の「訂正の理由 1 - 1」と同じ理由により "anomalies" の誤訳「偏差」を「異常」に訂正する。

(訂正の理由 10)

誤訳訂正 10 による訂正は、PCT出願明細書 9 ページ 15 行の "anomaly" の誤訳を訂正する補正である。

既述の「訂正の理由 1 - 1」と同じ理由により "anomaly" の誤訳「偏差」を「異常」に訂正する。

(訂正の理由 11)

誤訳訂正 10 による訂正は、PCT出願明細書 10 ページ 18 ~ 27 行の "anomaly" 及び "anomalies" の誤訳を訂正する補正である。

既述の「訂正の理由 1 - 1」と同じ理由により "anomaly" 及び "anomalies" の誤訳「偏差」を「異常」に訂正する。

(訂正の理由 12)

誤訳訂正 10 による訂正は、PCT出願明細書 19 ページ 7 行の "anomalies" の誤訳を訂正する補正である。

既述の「訂正の理由 1 - 1」と同じ理由により "anomalies" の誤訳「偏差」を「異常」に訂正する。

(訂正の理由 13)

誤訳訂正 2 による訂正は、PCT出願明細書 1 ページ 2 行の "anomalies" の誤訳を訂正する補正である。

既述の「訂正の理由 1 - 1」と同じ理由により "anomalies" の誤訳「偏差」を「異常」に訂正する。

(訂正の理由 1 4)

誤訳訂正 2 による訂正は、PCT出願明細書フロントページ、タイトル中の "anomalies" の誤訳を訂正する補正である。

既述の「訂正の理由 1 - 1」と同じ理由により "anomalies" の誤訳「偏差」を「異常」に訂正する。

添付書類の目録

訂正の理由の説明に必要な資料

物件名

英辞郎 on the WEB 当該ページのコピー

訂正の理由の説明に必要な資料

訂正の理由の説明に必要な資料

【訂正の理由 1 - 1 の説明に必要な資料】

- **anomaly**

【レベル】 11、【発音】 ənə'm(ə)li、【変化】《複》 anomalies、【分節】 a · nom · a · ly

【名-1】 例外 {れいがい} (的なもの [こと])、異例 {いれい}、不調和 {ふちょうわ}、異常性 {いじょうせい}、異常 {いじょう}、変則 {へんそく} (的なもの [こと])、変則性 {へんそく せい}、偏差 {へんさ}、奇形 {きけい}、異形 {いけい} [特徴的型から]のずれ]

• An anomaly defies easy description.: 例外に関しては簡単な記述ではすまない。

【名-2】 《天文》近点 {きんてん} (離) 角

【訂正の理由 1 - 4 の説明に必要な資料】

- **specular**

【発音】 spe'kj ə lə (r)、【分節】 spec · u · lar

【名】 鏡面反射

【形】 鏡の (ような)、反映する

- **specular angle**

反射角 {はんしゃかく}

- **specular glare**

鏡面眩輝 {きょうめん げんき}

- **specular image**

鏡像 {きょうぞう}

- **specular iron**

輝鉄鉱 {きてつこう}、鏡鉄鉱 {きょうてつこう}

- **specular light**

反射光 {はんしゃこう}

- **specular reflectance**

正反射率 {せい はんしゃりつ}

- **specular reflection**

正反射 {せいはんしゃ}

- **specular reflectivity**

鏡面反射率 {きょうめん はんしゃりつ}

- **specular reflector**

鏡面反射鏡 {きょうめん はんしゃきょう}

- **specular reflexion**

鏡面反射 {きょうめん はんしゃ}